

9 Rec'd PCT/PTO 22 MAR 2006

English Translation of Informal Comments  
on the Written Opinion of the International Searching Authority

In the Amendment under Article 19, the following amendments have been made.

5        In the claims, claim 3 now defines that the arrangement of the sealant is performed in an atmosphere. The limitations of original claims 10 and 11 are now defined as amended claim 11. Further, claim 13 now defines that the manufacturing apparatus includes only the pressure-reduced atmosphere creating means and releasing means, and it does not include plasma forming means and the like.

10      The Examiner of the International Searching Authority determines that original claims 1, 2, 4, 7, 9 and 10 lack novelty and an inventive step over Reference 1 (Japanese Patent Laying-Open No. 2001-242471).

15      As to claim 1, while Reference 1 describes arrangement of the substrate in an inert gas, it does not disclose that the deaerating step is performed "prior to the sealant arranging step". Reference 1 describes that the sealant is arranged in advance prior to arranging the substrate in the first cassette. It does not disclose or teach that the deaerating step is performed prior to the sealant arranging step, as defined by claim 1 of the present application. Accordingly, it is considered that claim 1 is not obvious to a person skilled in the art and thus has novelty and an inventive step.

20      Original claim 7 has been amended to be amended claim 8. Original claim 7 has been amended to incorporate a requirement that the liquid dropping step is performed in an atmosphere. That is, the amendment was made to incorporate a requirement of performing the liquid dropping step with the substrate being taken out in a normal atmosphere. Although Reference 1 discloses that liquid crystal is dropped in an inert gas, it does not disclose or teach that the liquid crystal is dropped in the atmosphere. Accordingly, it is considered that amended claim 8 is not obvious to a person skilled in the art and thus has novelty and an inventive step.

Original claim 10 has been amended to be amended claim 11. Original claim 10

has been amended to incorporate the limitations of original claim 11. It is considered that amended claim 11 has now novelty and an inventive step.

Informal Comments on the Written Opinion  
of the International Searching Authority (Japanese Only)

国際調査機関の見解書に関する非公式コメント

19条補正において、以下のように補正を行ないました。

請求の範囲において、シール材の配置を大気中で行なうことを、新たに請求の範囲3項に規定しました。また、補正前の請求の範囲第10項および請求の範囲第11項の内容を、補正後の請求の範囲第11項として規定しました。さらに、製造装置において、減圧雰囲気形成手段および開放手段のみを備え、プラズマ形成手段などを備えないことを、新たに請求の範囲第13項に規定しました。

国際調査機関の審査官は、文献1（特開2001-242471号公報）を引用文献として、補正前の請求の範囲第1-2, 4, 7, 9-10項は、新規性および進歩性を有しないとしています。

請求の範囲第1項に関しては、上記の文献1に基板を不活性ガス中に配置することが記載されているものの、「シール材配置工程の前に」脱気工程を行なうことは、開示されていないと認められます。文献1においては、シール材は、第1のカセットに基板を配置する前に予め配置しておくことが記載されています。本願の請求の範囲第1項に規定のように、シール材配置工程の前に脱気工程を行なうことは開示も教示（teaching）もされていません。したがって、請求の範囲第1項は、当業者にとって自明なものではなく、新規性および進歩性を有すると考えられます。

補正前の請求の範囲第7項に関しては、補正を行なって新たに請求の範囲第8項に規定しました。補正前の請求の範囲第7項に対して、液晶滴下を大気中で行なうことを要件に盛り込む補正を行ないました。すなわち、通常の大気中に基板を取り出して、液晶滴下を行なうことを要件に盛り込む補正を行ないました。文献1には、不活性ガス中で液晶を滴下することが開示されているものの、大気中に取り出して液晶を滴下することは開示も教示（teaching）もされていません。したがって、補正後の請求の範囲第8項は、当業者にとって自明なものではなく、新規性および進歩性を有すると考えられます。

補正前の請求の範囲第10項に関しては、補正を行なって新たに請求の範囲第11項に規定しました。補正前の請求の範囲第10項に対して、補正前の請求の範囲第11項の内容を盛り込む補正を行ないました。この補正により、補正後の請求の範囲第11項は、新規性および進歩性を有すると考えられます。

以上